

硬X射线XAFS实验方法

谢亚宁

北京同步辐射装置 中国科学院高能物理研究所 北京,2011.12.7-8





- 1) 两种基本实验方法
- 2) 透射 XAFS实验
 - ▶ 透射实验系统
 - ▶ 透射实验设置要点
 - ▶ 透射实验样品制备
 - ▶ 实验参数设置
 - ▶ 信噪比及探测灵敏度
- 3) 荧光 XAFS实验
 - ▶ 荧光XAFS原理及优势
 - ▶ LYTLE探测器的原理及使用
 - ▶ 半导体阵列探测器的原理特点及设置
 - ▶ 荧光XAFS样品要求
- 4) 其他基于XAFS的实验方法简介









XAFS实验的目地就是获取样品中激发元素的吸收谱。







XAFS试验系统组成的

- ◆ 电子储存环:当电子束团以相对论速度在储存环中运行时,产生同步辐射。同步辐射沿电子运动 切线方向出射,其能量覆盖从可见光到几百KeV的硬X射线,具有高强度,高准直,发射角小,广 谱,等一系列优点。
- ◆ 单色器:基于晶体衍射布喇格公式。其作用是对入射X射线单色化,对入射的广谱X射线仅反射出 满足布喇格关系的单能X射线;当转动晶体,改变X射线入射角θ,出射光的能量亦随之改变,实 现XAFS实验要求的单能可调X射线做能量(波长)扫描。
- ◆ 线性一致的透射探测器,一般为两个电流型电离室IC,样品前后个置一个。
- ◆ 控制及数据采集电子学系统,控制单色光能量扫描,同时读取前后电离室输出信号



5

透射实验设置要点



光路准直:

- 使用校正程序对能量标定:单色器读出的能量值是由布拉格角度计算得出,而由于反复机 械转动单色器角度会产生飘移。在改变扫描吸收边时应进行能量标定。方法对标样扫 描,获取吸收边附近的谱,根据吸收边的BRAGG角度值校正角度。 放大器放大倍数的设定:放大倍数设置过低,电子学系统的非线性会产生失真,过低高,
- 信号饱和。设置方法:观察428输出信号电压值,全谱扫描过程中都应在1-9V范围 内。
- 高次谐波抑制: 经单色器出射的单能X光束中含有高次谐波分量,高次分量产生背景噪音, 降低了获取数据的质量,需要抑制。方式: 微调单色器中双晶的失谐度(平行度)则 可有效抑制光束中高次谐波分量,同时保留大部分基波。调整原则: 监测通量l₀,调整 谐波抑制装置,根据经验数据,设定合适的l₀值;



高次谐波对谱对影响。谱: Ti的K 边



前后电离室对x束线吸收的调整



由理论分析可知前电离室吸收为20%,后电离室吸收为80%以上时,实验获取的数据信噪比最好。电离室对X射线吸收的大小与电离室长度,工作气体种类及X射线能量有关。改变实验能量而欲保持吸收比率基本不变,根据吸收公式则需改变工作气体的配比或换用不同长度的电离室;同时前后电离室工作气体一致性高有利于提高数据信噪比。







前电离室吸收率对谱对影响。前电离室吸收 为20%及85%采谱的比较。样品:Ti2O掺杂 Ru; 谱:Ti的K边



透射实验样品制备

调整样品厚度



- 由理论计算可知,当µ·t为一定值时,可得到最佳信噪比。常用样品厚度t取法是按:
- μ_后·t μ_前·t = 0.8~1.2,其中μ_前,μ_后为吸收限前、后的μ值。一般通过实验调整。可用厚度测试软件调整厚度。



Cu2O厚样与标准厚度样K边透射K空间谱比较

薄样与标准厚度样K边透射E空间谱比较



样品制备

对于透射XAFS实验,推荐使用粉末样品,粉末细度要达到400#(最怕pinholes及边缘漏光)。取宽度为1-2cm的胶带(推荐使用3M牌胶带)约20cm,将粉末均匀 撒在胶面上并涂匀,折叠胶带则可方便地调整厚度。

其他制样方法:

- 压片法,使用压片机,粉末样品亦可压片制样。
- 甩带或烧结等不能制成粉末的片状样品,其厚度应控制在10μm左右,面积应大于 5×10mm且不得有孔隙。
- 对于液体状态样品,建议使用样品盒,其制做方法可与本站人员讨论。









- 样品一般与光束垂直放置,中心重合。
- 前后电离室与样品之间的距离,在低能区实验中应为2-3cm左右在高能区实验中可适当加长到6-10cm,其原则是在保证光强的前提下,尽量减少样品散射光对电离室的影响。





实验参数设置



重要参数及设置原则

吸收边的选择

- 了解实验站提供的光子能量扫描范围,考察元素及吸收边到1keV能量范围是否能被覆 盖;
- 首先考虑K边,注意取谱范围与样品中其它元素吸收边是否重叠;
- 其次考虑L边。在L诸边中要选择至少边后几百个eV范围内没有重叠,按此原则一般取LIII边。

设置采样时间

采样时间越长,采谱的统计误差越小,但整个采谱时间加长。光强和采样时间是影响数据统计误差的两个因素。就同步辐射光强情况,在透射模式一般可选1~2秒采样时间。 能量扫描范围分段

目的是在数据质量与采谱时间取得兼顾的优化效果,通常将EXAFS谱的能量扫描范围 (1000eV左右)分为若干段,各段可设置不同的能量步长及采样时间。

Region	Starting Energy (eV)	Ending Energy (eV)	Step Size (eV)
Pre-edge	$E_0 - 200$	$E_0 - 20$	5.0 – 10
XANES	$E_0 - 20$	$E_{0} + 30$	0.25 – 1.0
EXAFS	$E_{0} + 30$	$E_{\rm o}+\sim 800$	$0.05 \ A^{-1}$







信噪比及探测灵敏度



1) 谱信噪比与测量的相对误差

- ◆ 噪声导致XAFS测量数据的误差,使µ(E)谱的质量降低,丢失了部分或全部的结构信息。噪声用信噪比(S/N)表达
- ◆ 同步辐射XAFS信号噪声重要来源之一是测量统计涨落误差。相对误差是从统计的角度对噪声的衡量。设某次采样光强为Ⅰ,采样时间为t,则该次采样总光子计数为 N=I·t,该次测量相对误差为:

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{N}} = \frac{1}{\sqrt{I \cdot t}}$$

 ◆ 对相同的采样时间,光强越强相对误差越小;而对相同的光强,采样时间越长 相对误差越小。

◆ 高质量的µ(E)谱,相对误差应该优于10³,则一次采样光子计数 N 必须大于 10⁶。
对于同步辐射而言,样品处光强I 一般大于10⁸,透射采样时间1秒就够了。



2) 信号背底比S/B



◆ S/B也是影响XAFS数据的S/N的重要因素。

S/N=S/(S+B)^{1/2}

S—信号, B-背底(包括散射及其他被激发元素的应该信号)

- ◆ 透射XAFS谱是由待测元素的XAFS信号及样品中其他元素贡献的吸收背底信号叠加构成。样品中待测元素含量越高,XAFS信号就越强。对于待测元素高含量的样品,XAFS信号幅度远大于吸收背底信号的影响,则采集的XAFS的实验原始谱就有高信噪比,谱的质量就好。
- ◆ 增大N(一次采样总光子计数),不能提高S/B
- ◆ 根据经验,透射XAFS实验样品中感兴趣元素含量应在10%以上。





荧光XAFS原理及优势



- 荧光信号中包含与感兴趣元素对应的荧光谱线lf,这是包含结构信息的XAFS信号;又 包含样品中其他元素对应的荧光谱线,以及以弹性和非弹性散射X射线,它们是背底信 号。
- 脊底信号与荧光谱线在能量轴上是分开的。在入射光扫描过程中,荧光谱线能量不变, 强度随入射光能量改变而变化,形成了µ(E),散射峰随入射光能量的提高而向高能端移动。
- > 荧光探测模式基于这一特点,通过物理或电子学手段,抑制背底信号部分,提高待测 元素荧光信号的比例,即提高信号背底比S/B,从而提高了S/N。
- 荧光XAFS实验方法对样品中痕量元素的探测灵敏度高(感兴趣的痕量元素含量可低至 ppm量级)在环境,生命,生物大分子结构等研究领域,往往痕量元素的近邻结构信息是非常重要的。对于低浓度样品荧光测量模式被广泛采用。



S

LYTLE探测器的原理及使用





- 滤波: 在样品与电离室之间插入金属或金属化合物薄片,由于元素特定的吸收边,使得边前后不同能量的X射线透过率不同,边前大,边后小
- 选择滤波片的原则:滤波片吸收元素的吸收边能量略高于样品中激发元素的荧光谱线lf 的能量,一般遵循Z-1原则,Z为测试元素序号。

Fe K_{α} 64	405
--------------------	-----

 $\mathsf{Mn}\,K\,\mathsf{edge} \qquad \mathbf{6539}$

- 索拉狭缝:有光学"焦点",其叶片的构形使样品的荧光信号最大限度的进入到探测器,而滤波片上产生的二次辐射被最大限度的屏蔽
- 探测器:电流型电离室;无能量分辨,动态范围大,大接收面积,大接收立体角,最大限度提高了接收的荧光信号通量,有助于S/N的提高。
- LYTLE电离室荧光XAFS方法适用于激发元素含量在10%至100ppm之间的样品;



- ◆ 与透射实验系统设置比较,区别是用荧光电离室输出信号取替了后电离室输出信号;
- ◆ 探测器轴线垂直于入射光束线90角,且水平放置。原因:SR轨道平面辐射为线偏振,弹性 散射在这一方向为0,则可优化S/N;
- ◆ 样品必须置于样品架并放置于样品盒中,原因:索拉狭缝:有光学"焦点"样品对于探测器位置敏感;
- ◆ 样品架有方向,原因同上;
- ◆ LYTLE探测器自带放大器, 替代了428, 但必要时也可用428替代;
- ◆ 荧光电离室为流气式,为得到足够的输出信号,工作气体使用应使用氩气;
- ◆ 采样时间设定一般需要比透射时间长(10秒)原因: If (荧光)比Ⅰ(透射)低若干量级, 增加 t, 可以提高S/N;
- ◆ 滤波片选择常规采用Z-1原则,非常规情况则遵循滤波片选择的基本原则,必要时可自制 滤波片。标准滤波片组的滤波片厚度有3/6两种吸收厚度可选,具体优化。



半导体阵列探测器的原理特点及设置



- 名称: 统称 Solid State Detector, 北京, 上海现用 Germanium Array Detector
- 与LYTLE功能相同,探测lf,原理不同,性能不同;
- 谱仪原理: 探头将入射光子转变为电脉冲,脉冲高度与光子能量成比例,电子学系统有两种组态:
- 多道(MCA)将脉冲按高度分类,分别累计于存储器阵列,最后形成了"计数-能量"的谱图;
- 单道(SCA)设上下阈值,使特定高度的脉冲通过并在存储器中累计
- 用MCA模式做系统设置,用SCA模式采样



GAD系统使用



- 开启硬件:高压电源,探头放大器电源,VME机箱电源,PC机电源;
- 运行X-manager程序:
- 1. 各道放大倍数统一校正;
- 2. 标定能量(铁源或确定能量的单能SR);
- 3. 定位激发元素的谱线,设定上下阈值;
- 4. 调整样品位置,光束的强度,使各道的计数均匀,死时间控制在30%以下,计数率追求高(但应在200KPS以下)
- 运行采样程序,与透射程序设置类似给定参数,开始采样







荧光XAFS样品要求



薄样品荧光信号 ($\mu t \ll 1$) $I_f \approx I_0 \frac{\epsilon \Delta \Omega}{4\pi} \mu_{\chi}(E) t$

厚但痕量样品荧光信号 ($\mu t \gg 1$) $I_f \sim I_0 \mu_{\chi}(E)$

厚且高浓度样品荧光信号 I

$$_{f} = I_{0} \frac{\epsilon \Delta \Omega}{4\pi} \frac{\mu_{\chi}(E)}{\mu_{\text{tot}}(E) / \sin \theta + \mu_{\text{tot}}(E_{f}) / \sin \phi}$$

其中µtot一项随入射光能量变化且不可忽略,严重可完全破坏了XAFS信号,这 种现象为自吸收(self-absorption),中等浓度样品谱可用数学方法(程序)修正; 荧光XAFS方法对高浓度样品不适用。

结论: 荧光XAFS实验对样品要求不高,但样品含量不可过高,适用范围: LYTLE探测器: 1%(wt)~100 ppm GAD探测器: 1000 ppm~10 ppm





不同粒径的Cu K边的荧光谱





对高含量样品用透射及荧光两种方法采的谱的比较



对痕量元素透射及荧光两种方法采的谱的比较



XAFS相关实验方法



- 1. 原位XAFS(高温,低温,压力,气氛)
- 2. 快速XAFS (QXAFS)
- 3. 掠入射XAFS (GIXAFS)
- 4. 高压XAFS
- 5. 异常衍射XAFS



低温环境室





参数:

温度范围: 10K-325K, 连续可调 ◆制冷功率: 8W@20K ◆结构: 两级脉冲管结构 ◆样品室结构: 四样品连装, 顶部 可装卸式样品架, 样品可转动及线 性位置调节设定 ◆加热器为50Ω



S



电流型高温	温原位室:	
温度范围:	室温-1200度;1*10 ⁻¹ Pa真空或惰性气体;	
测量方式:	透射或荧光;应用于固体样品的原位变温测量;	









原理:

使X射线掠入射(全反射角约为0.2°-0.3°)到样品,则入射X射线在样品表面发 生全反射,其入射深度为纳米量级,则获得的掠入射XAFS谱包含样品表面物质结 信息。

重要参数:

入射角调整范围: 0-90°

角度调整分辨率: 0.004°

垂直升降分辨率: 1µm



8keV以上 60GPa 以下

卸压过程中ZnSe的近边谱与FT变换结果

E (keV)

9.67

9.68

9.66



DAFS (4B9A X射线衍射站)





衍射峰强度随入射X射线能量变化而引起的振荡称作衍射异常精细结构 (Diffraction Anomalous Fine Structure,简称DAFS)。DAFS 技术将X射线衍射 (XRD)技术和X射线吸收谱(XAFS) 技术有机地结合在一起,可用于研究晶体中某一晶格位置上的原子配位信息。



4B9A束线

能量范围: 4-13 keV 单色器: Si(111)双平晶 能量分辩为: 3×10⁻⁴。 角分辨率: 0.9角秒 衍射仪: Huber六圆衍射仪 光斑尺寸: 0.9×1.5 mm² 全光斑强度: ~10¹⁰cps@8keV





谢谢!

